

Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2025/2026

Studia stacjonarne I stopnia - SEMESTR I

Ciąg, Grupa /Data	IB-111 (1IB-M), IB-112 (1IB-I) 1IB-E	MTMX-111 (10m)	IP-111	IP-112	IP-113	MT-111	MT-112	MT-113	MT-114	MT-115	MT-116	MT-117
02.02			egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2									
03.02	ANAL1 (I-termin) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 162, 168, 170 (GE)	CALC1 (Term 1) 14:15 r. 6 (GM)	TPM (I – termin) 8:15-10:00 s. 6, 11 (GM)					TPM (I – termin) 10:15-12:00 s. 6, 11 (GM)				
04.02	ME (I -termin) 11 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ s. 11 (GM)	AAG (Term 1) Part 2 11:00 r. 6 (GM) Part 1 12:30 r. 6 (GM)										
05.02	ALL (I-termin) 15 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ s. 107, 118-AL (GE)		MAT 2 (I – termin) 11:15-14:00 s. 6, 11, 422, 519 (GM)					MAT 2 (I – termin) 14:15-17:00 s. 6, 11, 422, 519 (GM)				
06.02	FI1 (I -termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 105-Ar (GE)	EPH (Term 1) 11:15-14:00 r. 11 (GM)	PMT (I – termin) 11:15-15:00 s. 6 (GM)									
07.02												
08.02												
09.02	ANAL1 (II-termin) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 170, 202 (GE)	CALC1 (Term 2) 14:15 r. 6 (GM)	TPM (II – termin) 8:15-10:00 s. 6, 11 (GM)					TPM (I – termin) 10:15-12:00 s. 6, 11 (GM)				
10.02		AAG (Term 2) Part 2 11:15 r. 519 (GM) Part 1 12:45 r. 519 (GM)										
11.02	ME (II - termin) 8 ¹⁵ – 10 ⁰⁰ s. 11 (GM)		MAT 2 (II – termin) 10:15-13:00 s. 6, 11, 422, 519 (GM)					MAT 2 (II – termin) 13:15-16:00 s. 6, 11, 422, 519 (GM)				
12.02	ALL (II - termin) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 202 (GE)	EPH (Term 2) 11:15-14:00 r. 6 (GM)										
13.02	FI1 (II -termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 170 (GE)		PMT (II – termin) 11:15-15:00 s. 6 (GM)									
14.02												
15.02												

(ITC) Institute of Heat Engineering - Nowowiejska 21/25 street

(ITLIMS) Institute of Aeronautics and Applied Mechanics - Nowowiejska 24 street (buildings along Al. Niepodległości)

(GM) Faculty of Mechatronics

Studia stacjonarne I stopnia - SEMESTR III

Ciąg i Grupa /Data	3IBM-M (IB-131), 3IBM-E	MTMX-131	IP-131 MT-134	IP-132 MT-135	MT-131	MT-132	MT-133
02.02			egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2				
03.02	POAUT (I – termin) 14 ¹⁵ – 16 ⁰⁰ s. 11 (GM)	BAC1 (Term 1) 8:15-11:00 r. 422 (GM)	WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (I – termin) 12 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ s. 6, 11, 422, 519 (GM)				
04.02	RAD (I – termin) 9:15-11:00 r. 519 (GM)	CALC3 (Term 1) 9:15 A0 (MEiL)	PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA – II (I – termin) 14 ¹⁵ – 16 ⁰⁰ s. 6, 11, 422, 519 (GM)				
05.02	RPR (I – termin) 15 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ s. 105-AR (GE)		ELEKTROTECHNIKA – I (I – termin) 8 ¹⁵ – 10 ⁰⁰ s. 6, 11 (GM)				
06.02	PELEL (I – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 162 (GE)	MOS1 (Term 1) 11:15-13:00 r. 422 (GM)	MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (I – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 6, 11, 422, 519 (GM)				
07.02							
08.02							
09.02	RAD (II – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 716 (GM)	BAC1 (Term 2) 8:15-11:00 r. 422 (GM)	WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (II – termin) 12 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ s. 6, 11, 519 (GM)				
10.02	RPR (II – termin) 15 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ s. 161 (GE)		PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA – II (II – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 6, 11, 519 (GM)				
11.02	POAUT (II – termin) 11 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ s. 716 (GM)	CALC3 (Term 2) 9:15 r. T204 (ITC)					
12.02		MOS1 (Term 2) 8:15-11:00 r. 422 (GM)	ELEKTROTECHNIKA – I (II – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 6, 11 (GM)				
13.02	PELEL (II – termin) 8 ⁰⁰ – 10 ⁰⁰ s. 162 (GE)		MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (II – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 6, 11, 519 (GM)				
14.02							
15.02							

[illegible]

Grupa Data	IBAME-171	MTMDS-171	MTIFO-171	IPAUT-171	IPIPM-171	MTMKM-171	MTMIN-171	IPROB-171	MTESP-171	MTTMU-171
02.02	BIT (I – termin) 8 ⁰⁰ – 10 ⁰⁰ s. 118-AL (GE) UEL (I – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 6 (GE)		OMP (I – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 517 (GM)		IPR (I – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 716				SMPM (I – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 206	
03.02	DEPJO (I – termin) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 6 (GE)						EUM (I – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244			
04.02	ADP (I – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 202 (GE)			DPP (I – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 716	SIWP (I – termin) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 244	PTB (I – termin) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 603	TINF (I – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 146	SIPR (I – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244	UIZE (I – termin) 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ s. 716	
05.02	EAMEB (I – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 422, 519 (GM)									DTP (I – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244
06.02	TEMI (I – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 170 (GE) AUS (I – termin) 8 ⁰⁰ – 10 ⁰⁰ s. 6 (GE)									
07.02										
08.02										
09.02	UEL (II – termin) 8 ⁰⁰ – 10 ⁰⁰ s. 120 (GE) DEPJO (II – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 121 (GE)		OMP (II – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 522 (GM)		IPR (II – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 146				SMPM (II – termin) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 206	
10.02	ADP (II – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 120 (GE)			DPP (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 716			EUM (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244			
11.02	BIT (II – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 017B (GE)				SIWP (II – termin) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 244	PTB (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 603	TINF (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 206	SIPR (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244	UIZE (II – termin) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 206	
12.02	EAMEB (II – termin) 14 ¹⁵ – 16 ⁰⁰ s. 6 (GM)									DTP (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 244
13.02	AUS (I – termin) 10 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰ s. 103 (GE) TEMI (II – termin) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 170 (GE)									
14.02										
15.02										

Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2025/2026

Studia stacjonarne II stopnia (projekt)

Grupy Data	MXUSM-211	IPS	
02.02		MTD (I – termin) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 11	
03.02		ZTPDM (I – termin) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 419, 420	
04.02		RDTR_IB (I – termin) 11 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 206	SMC (I – termin) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 11 (GM)
05.02			
06.02		FIZ_IB (I – termin) 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 206	
07.02			
08.02			
09.02		ZTPDM (II – termin) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 419	
10.02		MTD (II – termin) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 11	
11.02			
12.02		RDTR_IB (II – termin) 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ s. 206	SMC (I – termin) 11 ¹⁵ – 13 ⁰⁰ s. 11 (GM)
13.02		FIZ_IB (II – termin) 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 206	
14.02			
15.02			

Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2025/2026

Przyjęte skróty:

AAG	- Algebra and Geometry
ADMC	- Advanced Microcontrollers
AKU	- Podstawy akustyki i elektroakustyki
ALL	- Algebra liniowa
AMDD	- Analiza medycznych obrazowych danych dynamicznych
ANAL1	- Analiza 1
BAC1	- Basics of Automation and Control I
CALC1	- Calculus I
CALC3	- Calculus III
DEPJO	- Detekcja promieniowania jonizującego
DFO	- Diffraction and Fourier Optics
DPP	- Diagnostyka procesów przemysłowych
DTP	- Podstawy poligrafii i projektowania DTP
EAMEB	- Elektroniczna aparatura medyczna
EPH	- Engineering Physics
EPM	- Elementy i podzespoły mechatroniczne
ETAP	- Experiments - Theory and Practice
EUM	- Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
FI1	- Fizyka 1
FLM1	- Fluid mechanics I
FOP	- Fundamentals of Photonics
FOT	- Podstawy fotoniki
IAAD	- Industrial Automata and Devices
INOP	- Instrumental optics
IPAR	- Image Processing and Recognition
IPR	- Inżynieria oprogramowania
MDR	- Mechatronic drives
ME	- Metrologia
MEP	- Metrologia przemysłowa
MNN	- Metody numeryczne
MOP	- Medical Optics
MOS1	- Mechanics of Structures I
MOS2	- Mechanics of Structures II
MRP	- Maszyny i roboty pomiarowe
MSI	- Metody sztucznej inteligencji
MTD	- Matematyka dyskretna
MTL	- Programowanie w systemie MatLab
NEM	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych
NM1	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki I
NMOT	- Numerical Methods in Optical Techniques
NNSI	- Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej
OFiD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna
OFT	- Optical Fiber Technology
OI1	- Optyka instrumentalna I
OMP	- Opto-numeryczne metody pomiaru

ONMT	- Opto-numerical Methods and Testing
PELEL	- Podstawy elementów i układów elektronicznych
PMT	- Podstawy materiałoznawstwa technicznego i technologii przetwórstwa materiałów
POAUT	- Podstawy automatyki
PRPF	- Podstawy realizacji produkcji filmowej
PSA	- Projektowanie systemów automatyki
PTB	- Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych
PTS_IP	- Przetwarzanie sygnałów
PTS_MT	- Przetwarzanie sygnałów
RAD	- Radiologia
RDTR	- Radioterapia
ROB	- Robotyka
RPR	- Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
SIPR	- Sterowanie i programowanie robotów
SIWP	- Systemy informatyczne w przemyśle
SMC	- Systemy mechatroniczne
SMMD	- Simulations and models of mechatronic devices
SMPM	- Systemy pomiarowe
SPC	- Sterowanie procesów ciągłych
TELM	- Systemy telemedyczne
TEMI	- Technika mikroprocesorowa
TINF	- Transmisja informacji
TOE	- Technologia obwodów elektronicznych
TPM	- Technika pomiarowa
TPW	- Teoria pomiarów współrzędnościowych
UAP	- Urządzenia automatyzacji produkcji
UIZE	- Układy i zespoły elektroniczne
ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
ZTPDM	- Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych

	Tryb zdalny (remote)
	Zdalny mieszany (remote hybrid)
	Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)
	Stacjonarny (in line)